



MSP-12 in

マグネトロンスパッタ

大面積マグネトロンスパッタ装置

- 12インチウェハに対応する大面積試料ステージを搭載。
- コーティング電圧 500V 以下でイオンダメージを軽減するマグネatron方式を採用。
- オートコーティング機能で脱ガスから雰囲気ガス導入・コーティングまで全自動。
- 試料の出し入れが簡単な前方スライド式試料ステージを搭載。
- Ag ターゲットを装着すれば、透明フィルムなどの光沢処理も簡単に可能。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徴 ・ 仕 様

特 徴

- ★ MSP-12in は SEM 観察または光沢膜作製用イオンスパッタ成膜装置です。
- ★ 大面積ターゲットを使用。マグネトロン電極は、強力磁石と磁極リングの組み合わせによりターゲット金属表面に沿って外周から中心方向に磁場を作りターゲット全面を有効に利用できます。ステージ全域のコーティング厚さムラは 10% 以下。
- ★ スパッタ雰囲気ガスは、空気またはアルゴンを用います。空気導入の際に膜純度を高める（低抵抗値・高光沢）ために雰囲気ガスの流量を制限するバイパス管を搭載。
- ★ 低電圧でコーティングすることにより、デリケートなサンプルに用いても試料損傷がほとんどありません。
- ★ AUTO コーティングモードを装備。排気スタート・脱ガス・雰囲気ガス導入・コーティングまで全自動で完了します。
- ★ 試料ステージはサンプルの出し入れが簡単な前方スライド試料ステージを採用。
- ★ 排気系は RP (100ℓ/min)。クリーンルーム内でご使用される場合はスクロールポンプ（オプション）に変更する事も可能です。

仕 様

ターゲット	直径 300mm マグネトロン型
成膜対象金属	Pt, Au, Ag, Au-Pd, Pt-Pd
試料ステージ	直径 308mm
ターゲットー試料間隔	40mm
搭載可能試料サイズ	φ 300mm、h 25mm 以下
チャンバーサイズ	内径 330mm x 深さ 90mm
イオン化電圧／電流	DC 0～500V／0～1 A 電流計読み取り
タイマー	OMRON 社製電子タイマー
排気系	RP100ℓ/min
真空度測定	ピラニ真空計
雰囲気ガス導入	アルゴンガス必須
安全対策	サーキットプロテクタ、及び系統別フューズ付
装置サイズ	W450mm×D520mm×H420mm 重量 56kg
電源	単相 AC 100 V, 15A アース線付 3 芯プラグ使用

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。